

## 제 6 장 변위와 치수 측정

\* 참조: 참고문헌 (2) \*

### 6.1 서론

(참고문헌 2; 표 11.1)

Mechanical measurements 6<sup>th</sup> ed. Beckwith etc, Pearson Prentice Hall, 한철호 역

(1) 저분해능 장치 ( $1/100$  in,  $\sim 0.25$  mm)

강철자

캘리퍼스

(2) 중 분해능 장치 ( $1/10,000$  in,  $\sim 2.5 \times 10^{-3}$  mm)

マイクロ미터

버어니어 게이지

한계게이지

(3) 고분해능 장치 ( $2.5 \times 10^{-5}$  mm)

게이지 블록과 직접 비교하는 비교 측정기 사용

(4) 초고분해능 장치

레이저 간섭계

### 6.2 치수 측정에서의 문제

마모

접촉력

온도변화

### 6.3 Gage Block

#### (1) 개요

스웨덴 요한슨(Johanson) 개발  
특수공구강- 열처리-연삭-래핑-정마

재료:

초경  
ceramic

중앙치수; 측정면의 중심에서 측정  
최대치수-최소치수

Gage Block의 특징

- 광파장으로부터 직접 길이를 결정할 수 있다.
- 표시하는 길이의 정도가 매우 높다. ( $0.01 \mu\text{m}$ )
- 측정면이 서로 밀착되는 특성을 가지고 있어 몇 개의 수로 많은 치수의 기준이 얻어진다.
- 사용이 편리하다.

#### (2) 게이지 블록의 등급 및 규격

\* Gage Block의 등급

등 급		사 용 목 적
참조용	00	표준용 블록게이지의 정도 검사
		정밀학술 연구용
검사용	0	검사용, 공작용 블록게이지의 정도점검, 측정기류의 정도검사
		게이지의 정도 검사
		기계부품 및 공구 등의 검사
공작용	1	게이지의 제작
		측정기류의 정도 조정
		공구, 절삭공구의 장치

\* Gage Block 규격

정도 사양: ASME B89.1.9-2002 (미국)

공정 길이 (mm)	K급		00 급		0 급		1 급		2 급		
	치수공차	허용치수편차									
0.5 이하	±0.30μm	0.05μm	±0.10μm	0.05μm	±0.14μm	0.10μm	±0.30μm	0.16μm	±0.60μm	0.30μm	
0.5 초과	10 이하	±0.20μm	0.05μm	±0.07μm	0.05μm	±0.12μm	0.10μm	±0.20μm	0.16μm	±0.45μm	0.30μm
10 초과	25 이하	±0.30μm	0.05μm	±0.07μm	0.05μm	±0.14μm	0.10μm	±0.30μm	0.16μm	±0.60μm	0.30μm
25 초과	50 이하	±0.40μm	0.06μm	±0.10μm	0.06μm	±0.20μm	0.10μm	±0.40μm	0.18μm	±0.80μm	0.30μm
50 초과	75 이하	±0.50μm	0.06μm	±0.12μm	0.06μm	±0.25μm	0.12μm	±0.50μm	0.18μm	±1.00μm	0.35μm
75 초과	100 이하	±0.60μm	0.07μm	±0.15μm	0.07μm	±0.30μm	0.12μm	±0.60μm	0.20μm	±1.20μm	0.35μm
100 초과	150 이하	±0.80μm	0.08μm	±0.20μm	0.08μm	±0.40μm	0.14μm	±0.80μm	0.20μm	±1.60μm	0.40μm
150 초과	200 이하	±1.00μm	0.09μm	±0.25μm	0.09μm	±0.50μm	0.16μm	±1.00μm	0.25μm	±2.00μm	0.40μm
200 초과	250 이하	±1.20μm	0.10μm	±0.30μm	0.10μm	±0.60μm	0.16μm	±1.20μm	0.25μm	±2.40μm	0.45μm
250 초과	300 이하	±1.40μm	0.10μm	±0.35μm	0.10μm	±0.70μm	0.18μm	±1.40μm	0.25μm	±2.80μm	0.50μm
300 초과	400 이하	±1.80μm	0.12μm	±0.45μm	0.12μm	±0.90μm	0.20μm	±1.80μm	0.30μm	±3.60μm	0.50μm
400 초과	500 이하	±2.20μm	0.14μm	±0.50μm	0.14μm	±1.10μm	0.25μm	±2.20μm	0.35μm	±4.40μm	0.60μm
500 초과	600 이하	±2.60μm	0.16μm	±0.65μm	0.16μm	±1.30μm	0.25μm	±2.60μm	0.40μm	±5.00μm	0.70μm
600 초과	700 이하	±3.00μm	0.18μm	±0.75μm	0.18μm	±1.50μm	0.30μm	±3.00μm	0.45μm	±6.00μm	0.70μm
700 초과	800 이하	±3.40μm	0.20μm	±0.85μm	0.20μm	±1.70μm	0.30μm	±3.40μm	0.50μm	±6.50μm	0.80μm
800 초과	900 이하	±3.80μm	0.20μm	±0.95μm	0.20μm	±1.90μm	0.35μm	±3.80μm	0.50μm	±7.50μm	0.90μm
900 초과	1000 이하	±4.20μm	0.25μm	±1.00μm	0.25μm	±2.00μm	0.40μm	±4.20μm	0.60μm	±8.00μm	1.00μm

\* 별도의 성적서 첨부됨.

K급은 레이저인터페로미터를 사용한 성적서 첨부.

Gage Block Set (예)

크기 (mm)	스텝 (mm)	수량 (ea)
1.005		1
1.001 - 1.009	0.001	9
1.01 - 1.49	0.01	49
1.6 - 1.9	0.1	4
0.5 - 24.5	0.5	49
30 - 100	10	8
25, 75		2
		122

크기 (mm)	스텝 (mm)	수량 (ea)
1.005		1
1.01 - 1.19	0.01	19
1.2 - 1.9	0.1	8
1 - 9	1	9
10 - 100	10	10
		47

Gage Block 교정실 표준

등급	측정실의 온도	정밀도 $\mu\text{m}$	검사주기
00	20 °C ±0.2 °C	0.06 $\mu\text{m}$ 이하	1회
0			4회
1	20 °C ±0.5 °C	0.08 $\mu\text{m}$ 이하	2회
2			

사용법: 표면의 방청유를 휘발유로 세척

밀착시켜서 사용

휘발유로 세척, 방청유를 도포

### (3) 게이지 블록의 조립

(참고문헌 1; Fig. 11.4)

Mechanical measurements 6<sup>th</sup> ed. Beckwith etc, Pearson Prentice Hall, 한철호 역

### (4) 게이지 블록 보조 장치

## 6.4 정반 (Surface Plates)

주철

화강암

오래된 것으로 잔류응력이 적다

공구의 충격에 휘어지지 않음 (잔류응력이 없음)

부식되지 않음

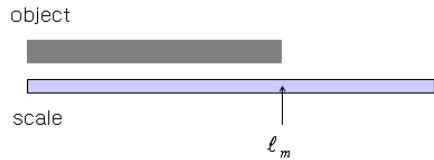
## 6.5 온도 변화가 길이측정에 주는 영향

표준측정온도  $20^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}\text{F}$ )

### \* 온도의 영향

길이측정의 표준온도 ;  $20^{\circ}\text{C}$

프랑스 미터원기;  $0^{\circ}\text{C}$  기준



$\alpha_1$ ; 측정기 재료의 열팽창 계수

$\alpha_2$  ; 피측정물의 열팽창계수

$t^{\circ}\text{C}$ 에서 읽은 scale 의 눈금  $\ell_m$  의 실제길이:  $\ell_m + \ell_m \cdot \alpha_1 \cdot (t - 20)$

표준 온도  $20^{\circ}\text{C}$ 에서 길이 L 인 물체의  $t^{\circ}\text{C}$ 에서 길이:  $L + L \cdot \alpha_2 \cdot (t - 20)$

$$\ell_m + \ell_m \cdot \alpha_1 \cdot (t - 20) = L + L \cdot \alpha_2 \cdot (t - 20)$$

그러므로

$$L = \ell_m \frac{(1 + \alpha_1 \cdot (t - 20))}{(1 + \alpha_2 \cdot (t - 20))}$$
$$\simeq \ell_m (1 + (\alpha_1 - \alpha_2) \cdot (t - 20))$$

## 6.6 비교측정기 (Comparator)

### (1) 비교 측정 방법

dial gage-block gage

Go-Stop gage의 교정

예제) 블록게이지와 다이얼 게이지를 이용하여 비교측정한다.

공칭치수 10 mm 인 블록게이지를 사용하여, 다이얼게이지의 0점을 세팅하고, 블록게이지를 빼고, 그 자리에 물체를 놓고 다이얼 게이지로 길이를 측정하였을 때 다이얼 게이지의 눈금이 15 mm 이다.

블록게이지 길이 오차는  $2 \mu\text{m}$  이고, 다이얼게이지의 오차는  $-1 \mu\text{m}$ 이다.

이때 물체의 실제 길이는 얼마인가 ?

옵셋은 더하고, 측정 오차는 빼준다.

블록게이지 공칭치수 10 mm, 다이얼 게이지 측정된 길이 15 mm 라면,

=> 물체의 길이는  $10 + 15 \text{ mm}$

그러나

블록게이지의 실제 길이는 (공칭치수 + 블록게이지 치수오차)

0점으로 세팅된 위치부터 읽은 대상물체의 실제 길이는 (다이얼 게이지 읽은 값 - 측정 오차),

대상물의 전체의 실제 길이 = (0점부터 측정된 물체의 실제 길이 + 블록게이지의 실제 길이)

따라서

블록게이지의 실제 길이는  $(10 + 2 \mu\text{m})$

0점으로 세팅된 위치부터 읽은 대상물체의 길이는  $(15 - (-1 \mu\text{m}))$  이므로,

대상물의 전체 실제 길이는  $(10 + 2 \mu\text{m}) + (15 - (-1 \mu\text{m}))$

## (2) 공압식 비교 측정기

경험식 (Graneek)

$$\left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 = \frac{P_s}{P_i} - \frac{P_i}{P_s}$$

$$\frac{O_i}{P_s} = 1.10 - 0.50 \frac{A_2}{A_1}$$

Remark)

공기마이크로미터

치수의 변화 <-> 공기의 유량 또는 압력의 변화

유량식, 배압식, 진공식

저압식: 0.05 ~ 0.2 kgf/cm<sup>2</sup>

중압식: 2.0 kgf/cm<sup>2</sup>

고압식: 2.0 kgf/cm<sup>2</sup> 이상

\* 유량식 공기 마이크로미터

노즐과 물체사이의 면적에 따라 유량이 변화  $Q \propto \pi dh$

틈새의 크기 h 가 0.015mm 까지는 마찰의 영향

틈새의 면적  $\pi dh$  가  $\pi d^2/4$  와 유사할 때 비선형성 발생

\* 배압식

유량변동에 따른 관 내부의 압력을 측정; 수은주, 벨로우즈, Bourdon관

\* nozzle-flapper 방식

$$Q = c_1 s_1 \sqrt{\frac{2g(p_1 - p_2)}{\gamma}}$$

$$= c_2 s_2 \sqrt{\frac{2gp_2}{\gamma}}$$

$$s_1 = \frac{\pi d_1^2}{4}, \quad s_2 = \pi d_2 h$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{c_2 s_2}{c_1 s_1}\right)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \left(\frac{4c_2 d_2}{c_1 d_1}\right)^2 h^2} \end{aligned}$$

- 압력조절기의 정확도가 영향을 줌.

- 작은 내경측정에 사용 가능

## 6.7 측정 공구

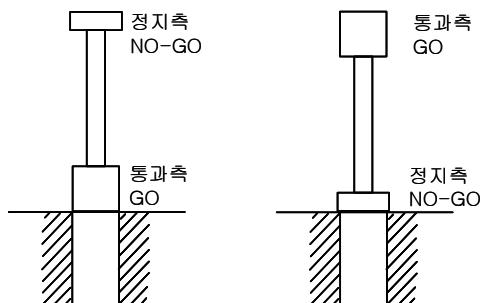
### (a) 자 및 표준자

재료: 58% 니켈강, 강과 같은 팽창율의 유리

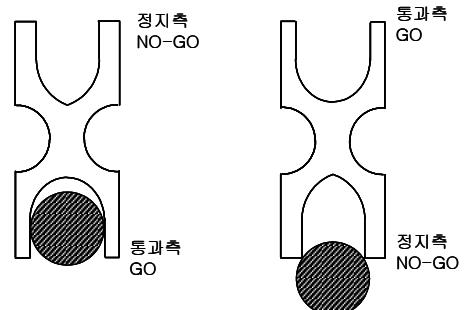
X, H, U형

### (b) 표준계이지

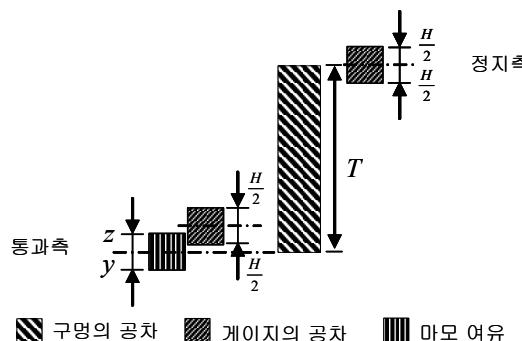
- \* 표준원통계이지  
플러그 게이지/링 게이지
- \* 표준나사게이지  
원통형 게이지 형태에 나사가 되어있다. (plug/ring gage)
- \* 표준테이퍼게이지  
원통형 게이지 형태에 테이퍼가 되어있다.  
선반: 모오스(Morse taper)  
밀링: Brown & Sharpe taper
- \* 한계게이지



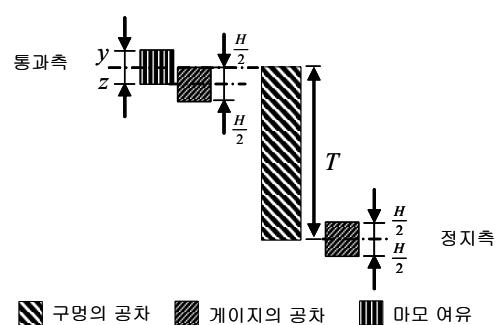
(a) 구멍용 게이지



(b) 축용 게이지

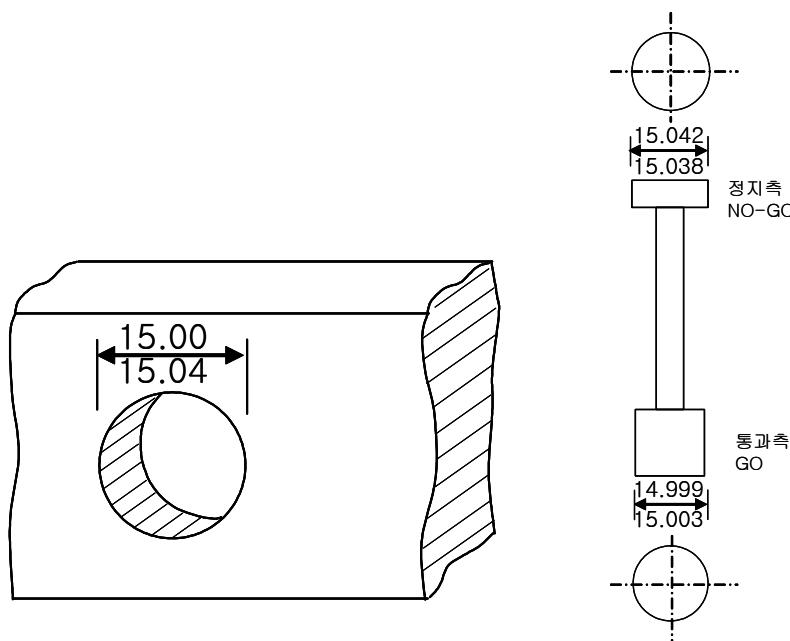


(c) 구멍용 게이지 치수



(d) 축용 게이지 치수

예) 구멍용 한계게이지



- \* 간극(thickness) 게이지  
미세한 간극을 측정  
0.03mm ~ 0.5mm
- \* 반지름(radius) 게이지  
반경측정
- \* center 게이지
- \* 피치게이지  
나사의 피치검사용, 기어의 치형 검사용
- \* wire gage  
선재의 지름을 측정  
번호가 큰 것->지름이 작다.
- \* drill gage  
드릴의 직경검사

### (c) 각도의 표준 및 공장용 표준기

각도: 원주의 길이와 원의 반지름의 비  
유도단위

#### (c-1) 각도계이지

\* Johansson형의 각도계이지  
(50mm X 20mm X 1.5mm) 85개 또는 49개  
정밀도:  $\pm 12''$

$10^\circ \sim 11^\circ 1'$  식 15개, A형  
 $0^\circ \sim 90^\circ 1'$  식 40개 ; A형 7개, B형 33개  
 $89^\circ \sim 90^\circ 1'$  식 30개 C형

사용법: 2장씩 맞대어서 사용  
 $1'$  또는  $5'$  간격 (정밀도  $\pm 24'$ )  
 $10^\circ$  이하,  $350^\circ$  이상은  $1^\circ$  간격으로

\* NPL형 각도계이지  
1941, G.A.Tomlinson

$41^\circ, 27^\circ, 9^\circ, 3^\circ, 1^\circ, 27', 9', 3', 1', 30'', 18'', 6''$   
밀착방향을 바꾸면 각도를 +, 또는 -

#### (c-2) Polygon거울

측면을 정밀하게 가공  
8면체, 12면체

#### (c-3) 각자(square)

#### (c-4) 눈금원판

## 6.8 측장기

### 6.8.1 측정용 현미경

1) Fixed scale microscope

2) Pillar microscope

3) Traveling & traveling-Stage microscope

4) Draw tube microscope

5) 초점맞춤 (focusing)



Tool Scope (측정현미경)

## 6.8.2 측장기

### (a) 일반구조

표준자, 미끄럼대, 측미현미경, 지지장치, 측정대

앤빌 사이에 피측정물을 삽입하고, 눈금을 읽어서 길이를 측정

### (b) Abbe's comparator principle

표준자의 눈금면과 측정축이 일치하는 구조 => 베드의 오차영향이 적다.

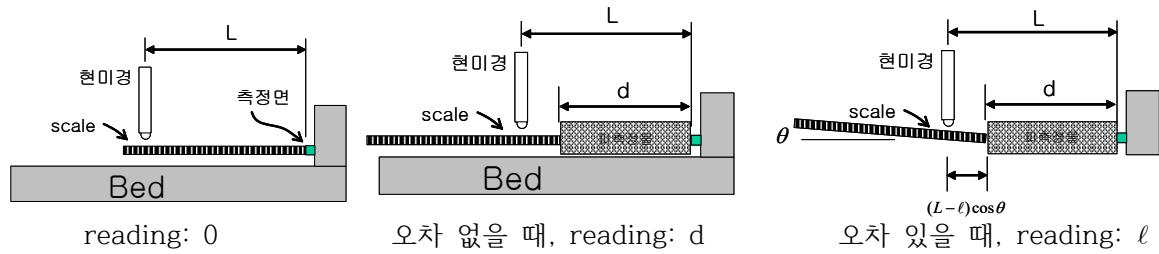
“시선에 대해 직각인 방향으로 측정을 행할 때에는, 현미경을 이동시키지 말고 피측정물을 움직여서 측정해야 한다.”

#### (i) Abbe의 원리에 의한 측장기

$L$  : 측정면과 현미경간의 거리

$d$  : 물체의 길이

$\ell$  : 현미경으로 읽은 눈금



$d - \ell$  ; 측정오차

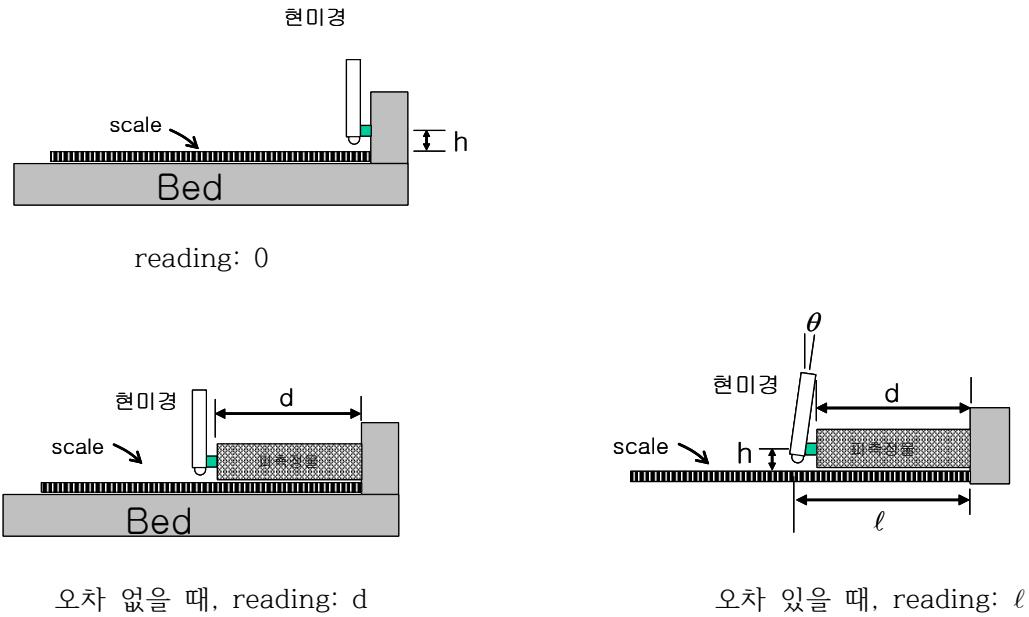
$$(L - \ell) \cos\theta + d = L$$

$\theta \ll 1$  이므로

$$d - \ell = (L - \ell) \theta^2 / 2$$

(ii) Abbe의 원리에 맞지 않는 측장기

현미경이  $d$  만큼 이동할 때  $\theta$  만큼 기울어지면  
 $h$ : 측정축선과 표준자 눈금면 간의 거리



측정 오차:

$$\ell - d = h \tan \theta \\ \approx h \cdot \theta$$

예제) 다음의 각각의 경우에 허용할 수 있는 경사각도는 ?

(i) Abbe의 원리에 의한 측장기

$L=150\text{mm}$ : 측정면과 눈금자의 영점거리

$d=100\text{mm}$

오차  $d - \ell = 0.1\mu\text{m}$

$$1\text{rad} = 360^\circ / 2\pi \times 60 \times 60 = 2.06 \times 10^5 \text{sec}$$

$$d - \ell = (L - \ell) \theta^2 / 2 \text{ 으로부터}$$

$$\begin{aligned} \theta &= 2.06 \times 10^5 \sqrt{2(d - \ell) / (L - \ell)} \\ &= 2.06 \times 10^5 \sqrt{2 \times 0.0001 / (150 - 100)} \\ &= 400'' \end{aligned}$$

(ii) Abbe의 원리가 아닌 측장기

$h=50\text{mm}$

$$d - \ell = h \tan \theta \text{ 로부터}$$
$$\approx h \cdot \theta$$

$$\theta = \frac{d - l}{h}$$

$$= 0.0001/50$$

$$= 2 \times 10^{-6} \text{rad}$$

$$= 2 \times 10^{-6} \times 2.06 \times 10^5$$

$$= 0.4$$

아베의 원리의 적용

\* 선반공구대의 위치결정

정밀가공을 위해서 공구 끝 날의 위치를 정확하게 결정해야함

가로이송대의 위치는 핸들주위의 눈금과 이송대의 축이 일치하기 때문에 아베의 원리에 맞음

공구 끝 날의 위치는 가로이송대의 중심에서 높이  $h$  만큼 떨어져 있음.

눈금선, 공구 끝날, 공작물의 중심이 같은 평면상에 있을 때에 고정도의 위치결정이 가능

3차원측정기에서 상하방향 (Z)축은 아베의 원리에 맞으나 X, Y축은 맞지 않음.

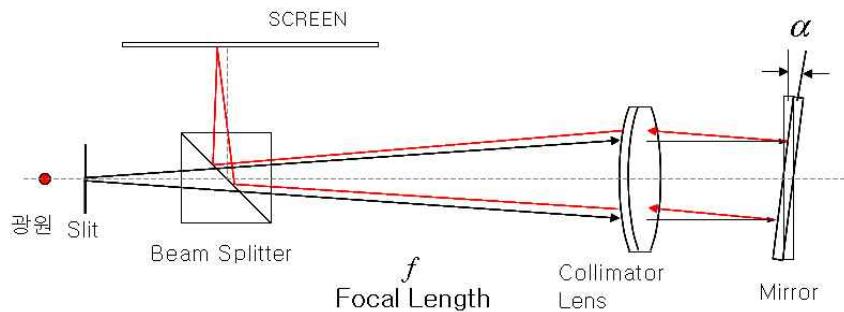
## 6.9 Autocollimator

대형 기계의 제작, 조립  
(참고문헌 1: section 11.16)

alignment telescope  
collimators  
autocollimators  
accessory

초점에 눈금있는 유리판 배치하고 렌즈로 평행광을 얻는 장치  
오토콜리메이션 현미경

straightness, parallelism, tilt: milling table  
flatness : 정반  
position uncertainty : index table 의 회전각도  
squareness : 밀링의 스펜들 측  
centering, adjustment : 선반의 주축  
angle measurement : 프리즘의 직각도



$$d = \tan(2\alpha) \cdot f$$
$$\approx 2 \cdot \alpha \cdot f$$

- 육면체의 직각도 검사  
펜타프리즘 사용



<http://www.moeller-wedel-optical.com>



### 6.10 투영기

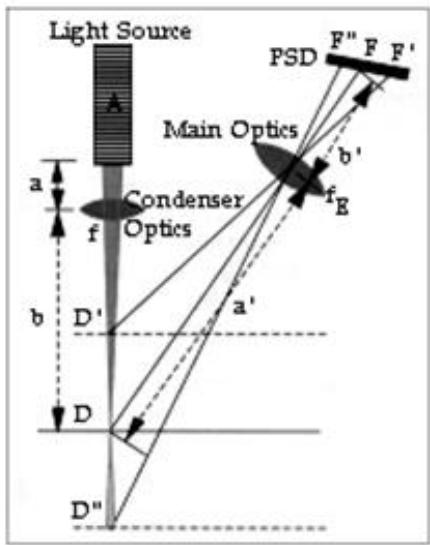
<http://www.mitutoyokorea.com/>



### 6.11 공구현미경



## 6.12 삼각법을 이용한 변위 측정기



**Figure 1.**  
The triangulation probe.

$$\frac{1}{a'} + \frac{1}{b'} = \frac{1}{f_E}$$

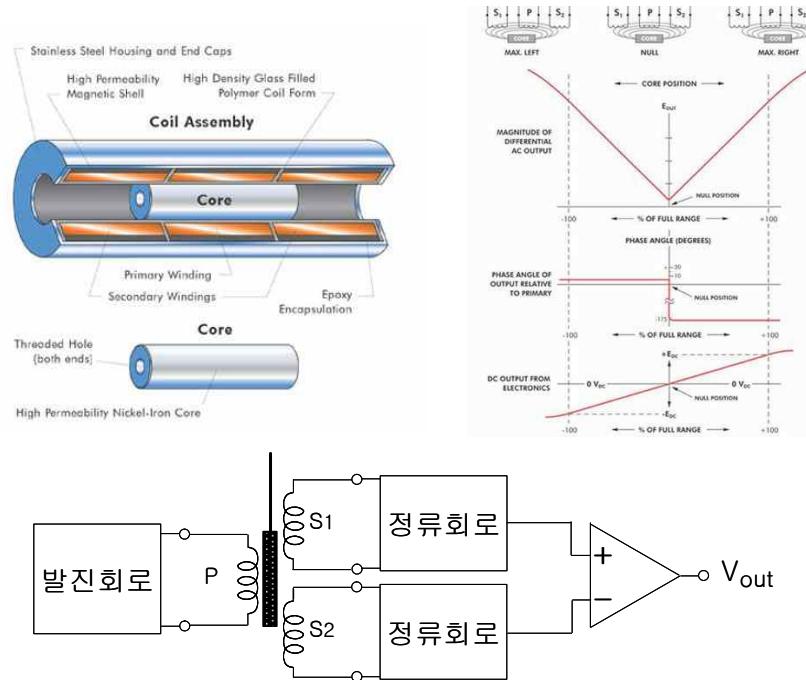
### 6.13 미끄럼 접촉장치

가변 저항: 위치에 따라 저항 값이 변화

접촉부의 마모에 의하여 내구성이 떨어짐.

## 6.14 Differential Transformer

Linear Variable Differential transformer (LVDT)



1차코일에 교류전압 인가; 5kHz, (400Hz ~ 50KHz)

2차코일의 유기전압  $e_1$ ,  $e_2$ 의 차이를 이용

직류LVDT:

transistor 발진기와 정류기를 내장

장점:

측정법위가 넓음: 0.01mm ~ 100mm

측정정도, 감도, 직선성, 내구성등이 우수

1차 변환만 한다. (2차변환이 필요없음)

기계적 과부하가 없음, 절연, frictionless

온도에 민감하지 않음

높은 출력 (증폭작용 필요없음)

unique feature of LVDT

- o frictionless
- o infinite mechanical life
- o infinite resolution
- o null repeatability - no drift
- o complete isolation

단점:

철심의 무게가 크다. (동특성이 불량)

이용례:

- 오리피스식 유량계
- 면적식 유량계; float이용
- 판두께의 측정
- 하중계; 힘에 의한 스프링변형을 LVDT로 측정

## 6.15 Surface roughness 측정

stylus

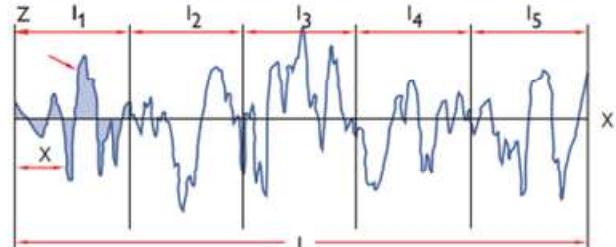
laser (non-contact)

\* 표면거칠기의 표시

평균거칠기; Ra (미국규격)

$$R_a = \frac{1}{L} \int_0^L |z(x) - h| dx$$

$$h = \frac{1}{L} \int_0^L z(x) dx$$



최대; Rmax (한국규격)

$$R_{\max} = |z_{\min} - z_{\max}|$$

RMS; Rrms

$$\epsilon = z(x) - h$$

$$R_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{\sum \epsilon^2}{n}}$$

$R_{\text{rms}}$  가  $R_a$  보다 11% 크다.